

貸付機械器具一覧

【R4.4.1現在】

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	530
M102	帯のこ盤	270
M103	小型平面研削盤	850
M106	精密切断機	550
M108	ジグ中ぐりフライス盤	660
M111	雰囲気調整電気炉	1,650
M112	高周波誘導電気炉	1,260
M113	放電プラズマ焼結機	2,350
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,550
M115	粉末処理装置	140
M116	手動切断機	210
M117	試料埋込機	1,160
M118	自動研磨装置	3,530
M119	精密ワイヤ放電加工機 (B軸無使用)	2,570
M120	精密ワイヤ放電加工機 (B軸使用)	3,420
M121	高速加工機	3,010
M122	CAD/CAMシステム	690
M123	超高温電気炉	280
M124	真空含浸装置	690
M125	精密切断機(硬質・脆性材料切断)	1,010
M200	万能試験機	630
M201	精密万能試験機(250kN)	1,180
M203	表面性測定機	670
M204	内部欠陥判定装置	470
M205	ワックス物性試験機	170
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,700
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M208	高温顕微硬度計	2,420
M209	薄膜硬度計	280
M210	摩擦磨耗試験機	1,320
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,400
M212	表面粗さ測定装置	1,740
M214	CNC三次元測定機	4,350
M215	万能形状測定装置	990
M216	サーモグラフィ	910
M218	FFTアナライザ	230
M219	構造解析システム	1,700
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	420
M222	測定顕微鏡	830
M223	万能投影機	370
M224	超微小硬さ試験機	540
M225	デジタル金属顕微鏡	610
M226	コンピュータ設計支援システム	490
M227	加工機制御用CAD/CAMシステム	790
M228	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(計測処理)	8,200
M229	非接触3次元デジタイジングシステム	3,750
M230	表面性状測定機	2,580
M231	高倍率型顕微鏡	600
M232	卓上型走査電子顕微鏡	2,250
M233	微細形状観察評価装置(レーザー顕微鏡)	1,980
M234	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(ポスト処理)	930
M235	非接触3次元デジタイジングシステム(2021)	2,020
M236	精密騒音計	350
M237	風量測定器	760

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
C100	射出成形機	1,480
C102	精密切断機	920
C104	マイクロカッティングマシン	540
C105	小型射出成形機	1,090
C106	油圧真空加熱プレス	1,390
C200	F T赤外分光光度計	2,680
C201	X線回折装置	3,280
C203	静荷重試験機	1,580
C205	電界放出型走査電子顕微鏡(分析)	6,950
C206	電界放出型走査電子顕微鏡(観察)	5,830
C208	熱分析装置	2,060
C209	X線分析顕微鏡	2,100
C211	粉末特性評価装置	800
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,380
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,500
C214	混練性・押出性試験装置	3,790
C216	比表面積・細孔分布測定装置	770
C217	X線光電子分光分析装置	4,470
C218	イオンクロマトグラフ(陽イオン)	1,380
C219	イオンクロマトグラフ(陰イオン)	1,350
C220	イオンビームミリング装置 (電子顕微鏡用試料作成装置)	2,090
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,310
C222	低温プラズマ分解装置	520
C223	マイクロサンプリングマシン	960
C225	マイクロ波分解装置	860
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)	2,570
C227	紫外可視分光光度計	170
C229	恒温恒湿器(新)	160
C230	卓上型pHメーター	420
C231	実体顕微鏡システム	170

W100	丸鋸昇降盤	190
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	210
W102	手押し鉋盤	230
W103	自動鉋盤	390
W104	定温乾燥機	250
W105	ディスクリファイナー	1,170
W106	ホットプレス	370
W107	恒温恒湿器	160

J100	電磁界解析ツール	720
J104	微小部X線応力測定装置	740
J105	三次元磁界ベクトル分布測定装置	160
J106	真空均温熱処理装置	560
J200	磁気シールドルーム	11,420
J201	ヘルムホルツコイル	310
J202	直流磁化測定装置	1,940
J203	ソレノイドコイル	470
J204	校正用機器	160
J205	ガウスメータ	250
J206	レーザドップラ振動計	1,630
J207	パワーアンプ	530
J208	パワーアナライザ	760

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
F101	低温恒温恒湿機	310
F102	クリーンベンチ	200
F103	真空凍結乾燥機	1,320
F104	ドラム乾燥機	840
F105	真空包装機	180
F106	低温高速遠心機	330
F107	プレハブ仕込室	180
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,700
F111	細胞破砕装置	210
F112	微生物増殖装置	490
F117	スプレードライヤー	280
F118	高圧ホモジナイザー	350
F119	微細装置	580
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	130
F200	水分活性測定装置	470
F201	測色色差計	380
F206	近赤外分析装置	1,690
F207	高速液体クロマトグラフ	1,310
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	660
F211	自記光電分光光度計	420
F212	原子吸光分析装置	830
F213	pHメーター	210
F214	密度比重計	150
F215	蛍光プレートリーダー	810
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	5,900
F217	マイクロファイバースコープ	880

E100	スパッタリング装置	1,830
E104	真空熱処理装置	810
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	270
E201	2GHz帯デジタル・オシロスコープ	260
E204	分光光度計 (電子材料分光特性評価装置)	580
E209	ネットワーク・アナライザ	590
E300	電波暗室	5,060
E301	雑音電界強度測定器	1,810
E302	雑音端子電圧測定器	1,710
E303	雑音電力測定器	1,670
E304	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	240
E305	放射イミュニティ試験器	2,200
E306	伝導イミュニティ試験器	1,300
E307	静電気試験器	300
E308	商用磁界試験器	440
E309	アンテナ計測システム	1,210
E310	オシロスコープ	310
E400	ドローンテスト用ネット	1,220

999	その他の機械器具	100
-----	----------	-----

P100	サンプルカット用プロッタ	440
P101	3Dプリンタ①(材料持込)	1,070
P102	3Dプリンタ②(0.1270mm)	1,710
P103	3Dプリンタ③(0.1778mm)	2,190
P104	3Dプリンタ④(0.2540mm)	2,720